PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-016268

(43) Date of publication of application: 17.01.1997

(51)Int.CI.

G05D 7/06 G05B 11/36

(21)Application number: 07-188033

(71)Applicant: TAKAHASHI HISASHI

CKD CORP

(22) Date of filing:

29.06.1995

(72)Inventor: TAKAHASHI HISASHI

KOKETSU MASAYUKI

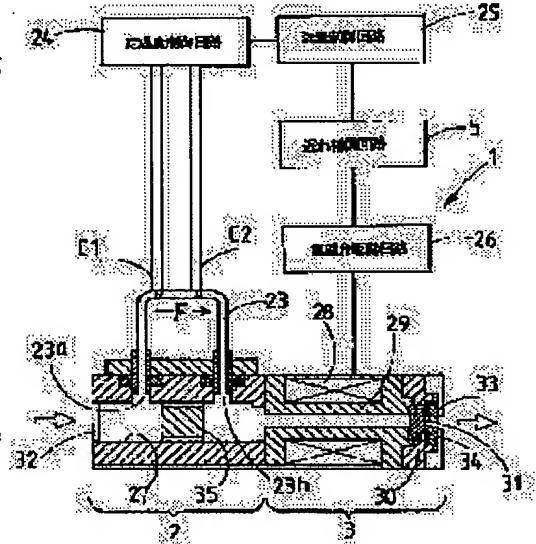
NITTA SHINICHI

(54) FLOW RATE CONTROL VALVE WITH DELAY COMPENSATING FUNCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a flow rate control valve with the delay compensating function which becomes stable in flow rate in a short time after gas is started to supply by providing a delay compensating circuit.

CONSTITUTION: When the gas is started to supply by opening a cutoff valve, a gas flow rate is outputted from the flow meter part 2 of the flow rate control valve 1 with the delay compensating function. This output value includes time delay against variation in actual flow rate of the gas. For the purpose, the delay compensating circuit 5 compensates the delay to generate a signal having the time delay canceled. On the basis of the signal, the solenoid valve part 3 of the flow rate control valve 1 with the delay compensating function is controlled to adjust the flow rate. Consequently, the flow rate becomes stable in a short time after the gas is started to supply, so a response stabilization wait time can greatly be shortened and the outflow of unnecessary gas is reducible.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.08.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2802246 10.07.1998 [Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-16268

(43)公開日 平成9年(1997)1月17日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
G05D	7/06			G05D	7/06	Z	
G05B	11/36	501	0360-3H	G05B	11/36	501L	•

表音音音	有	請求項の数3	FD	(全 13	耳)

(21)出願番号	特願平7-188033	番金請求 有 請求項の数3 FD (全 13 頁)
(51) ITIMATE (1	100032	(71)出願人 595106947 高橋 久
(22)出顧日	平成7年(1995)6月29日	神奈川県相模原市上鶴間2647番地の1 ラ イオンズガーデン町田604
		(71)出願人 000106760
, .		シーケーディ株式会社
	•	愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地
		(72)発明者 高橋 久
		神奈川県相模原市上鶴間2647番地の1 ラ
		イオンズガーデン町田604
		(74)代理人 弁理士 宮澤 孝 (外2名)
	·	

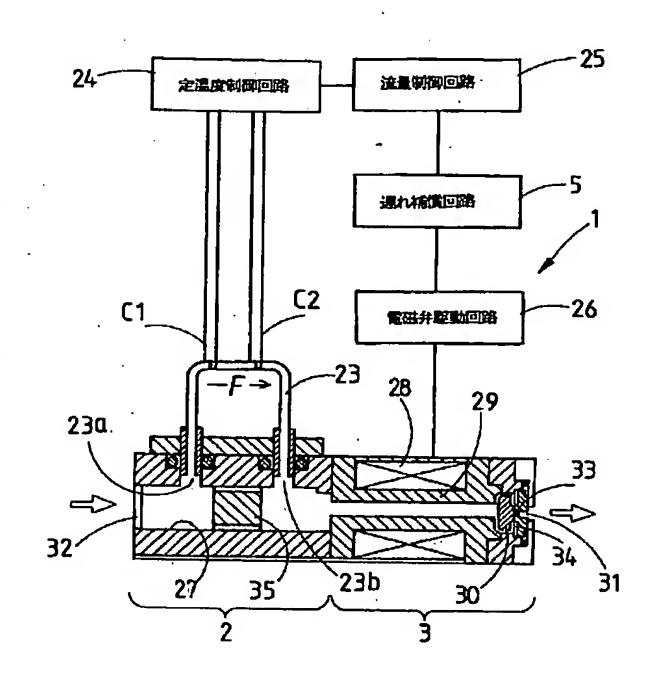
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遅れ補償機能付流量制御弁

(57)【要約】

【目的】 遅れ補償回路を備えることにより、ガス供給開始後短時間に流量が安定する、遅れ補償機能付流量制御弁を提供する。

【構成】 遮断弁を開いてガスの供給を開始すると、遅れ補償機能付流量制御弁1の流量計部2からガス流量が出力される。かかる出力値は、ガスの実流量の変化に対して時間遅れを含んでいる。そこで、遅れ補償回路5がこれを補償し、時間遅れのキャンセルした信号を発生する。これに基づき遅れ補償機能付流量制御弁1の電磁弁部3が制御され流量の調整がなされる。これにより、ガス供給開始後短時間で流量が安定するので、応答安定待ち時間を大幅に短縮でき、ガスの無駄な流出も減少させることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 気体の流量を調整する流量調整手段と、 その気体の実流量を測定する流量計とを有し、その流量 計の出力値により流量調整手段を制御する流量制御弁に おいて、

1

前記流量計の出力値変化の時間遅れを補償する遅れ補償 手段を備えることを特徴とする遅れ補償機能付流量制御 弁。

【請求項2】 前記遅れ補償手段が、時定数の異なる複 数の1次遅れ関数を併用して前記流量計の出力値変化の 10 時間遅れを補償することを特徴とする請求項1 に記載の 遅れ補償機能付流量制御弁。

前記遅れ補償手段が、1つの1次遅れ関 【請求項3】 数により前記流量計の出力値変化の時間遅れを補償する ことを特徴とする請求項1に記載の遅れ補償機能付流量 制御弁。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体集積回路製造設 備中のガス供給装置に使用する流量制御弁に関し、さら 20 に詳細にはガス供給開始時の流量計の応答遅れを補償し て、供給ガスの無駄を排除できる遅れ補償機能付流量制 御弁に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体集積回路の製造は、微細加工工程 と成膜工程とを繰り返すことにより、半導体基板(以 下、「ウェハ」という)上に微細回路を形成することに より行われる。かかる半導体製造の諸工程を行う装置に は、特殊ガスを使用する装置が多い。例えば、微細加工 装置のうちの乾式エッチング装置では、塩素系等の腐食 30 性ガスを使用する。あるいは、成膜工程のうち層間絶縁 膜やゲート電極の形成を行う化学蒸着気相成膜(以下、 「CVD」という)装置では、膜成分供給源としてシラ ン(SiH₄)、ホスフィン(PH₃)、ジボラン(Bړ H。)等の特殊材料ガスを使用する。以下、これらの装 置を総称してガス使用装置という。

【0003】これらガス使用装置においては、所定の処 理を施すための槽内にウェハを載置し、所定のガスを所 定流量流しながら必要に応じて加熱やプラズマ印加等を 行うようになっている。ここで、処理槽へのガスの供給 40 にあたっては図20に示すように、ガスを供給するガス 源70と処理槽74との間にフィルタ71、圧力調整弁 72、圧力センサ73、流量コントローラ75を配設す る。流量コントローラ75は流量センサを内蔵してい る。そして、圧力センサ73の前段及び流量コントロー ラ75の前後に遮断弁76、77、78を配置する。か かるガスラインにおいて、流量コントローラ75で内蔵 する流量センサの出力値をフィードバックするととによ り、一定流量のガスを安定供給できるようになってい る。かかるシステムにより、処理槽への供給ガスの圧力 50 つは、槽内に1枚もしくは2枚程度のみのウェハを載置

や流量の設定や、供給の停止ができるようになってい る。

【0004】しかしガス使用装置においては、1種類の ガスのみを使用することは稀で、2種類以上のガスを同 時に使用するのが普通である。例えばプラズマCVD装 置で酸化珪素膜を形成する場合は、珪素源としてのシラ ンの他、酸素源としての一酸化二窒素N2Oガスと、反 応促進と不要な酸化阻止とのための水素Hュガスと、希 釈用の窒素N,ガスとを同時に使用する。したがって図 20のようなガス供給システムも、使用するガスの種類 数に応じてそれぞれ必要となる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記し た流量センサおよび流量コントローラには、以下の問題 点があった。すなわち、ガス流量を検出する流量センサ は、測定する流量の変化に対して必ずしも応答性が優れ ているとは限らない。したがって、ガス供給を開始する 際、ガスが流れ始めてから流量センサが実際に一定の流 量値を出力するまでには、若干の遅れがある。

【0006】このため、かかる出力値のフィードバック を受ける流量コントローラ75の制御回路は、ガス供給 開始直後においては、実流量より低い流量値を認識する ので、これを補おうとして流量コントローラ75の許容 流量を過剰に増大させることになる。このためガスの実 流量は、図21に見るように一旦オーバーシュートして から所定の流量に落ち着くこととなる。

【0007】したがって、ガス供給を開始するために遮 断弁76等を開いてから、実際に設定流量のガスが安定 して流れるまでには、かなりの遅れがある。この時間遅 れの間に流れるガスは設定流量と異なるので、これをガ ス使用装置に送り込んでプロセスを実行すると、膜厚、 膜質、エッチレート等のプロセス特性の異常をきたす。 これを避けるためガス流量が安定してからプロセスを行 うので、この時間遅れの間のガスはプロセスに使用され ることなく、そのまま無駄に流れてしまうことになる。 【0008】しかも、かかる遅れ特性は供給しようとす るガスの種類により異なり、さらに、流量センサ自体の 個体差もある。したがって、複数のガスを供給する場合 には、図10に示すように各ガス供給系のうち最も遅れ が大きいガスdが安定するまでの間は、他のガスも無駄 に流さざるをえないのである。図10は、遮断弁76等 を開いた後の、各ガスの流量センサ出力値の経時変化を、 示すグラフである。ことでは、ガスdの流量が安定する まで4秒程度かかっている。

【0009】ここでウェハの処理の態様により、ガス使 用装置を2種類に大別することができる。1つは、処理 槽を大きく形成して、槽内に50枚程度のウェハを同時 に載置して処理を行う、いわゆるバッチ式処理といわれ るもので、減圧CVD装置等がこれに該当する。もう1

し、処理とウェハ交換とを順次行う、いわゆる枚葉式処理といわれるもので、乾式エッチング装置やプラズマC VD装置等がこれに該当する。

【0010】バッチ式処理が生産性の高さを特徴とするのに対し、枚葉式処理は処理のウェハ間均一性(例えば 膜厚等)を特徴とする。そして、近年における回路素子の一層の微細化とともに、膜厚等の均一性がより強く必要とされるに至っていることから、次第に枚葉式処理の 占める比重が強まりつつある。かかる枚葉式処理においては、処理一回毎にウェハ交換を行う。ウェハ交換にあ 10 たっては、一旦プロセスガスの供給を遮断し、処理槽を 窒素ガス等で掃気してから処理槽を開いてウェハの交換を行い、しかる後に再びプロセスガスの供給を開始する ことになる。プロセスガスの多くは、猛毒性、自然発火性を有し非常に危険であるため、装置外への流出は許されないからである。むろん、この一連の動作は自動化されるのが普通である。

【0011】したがって枚葉式処理の場合、プロセスガスの供給を開始する回数が非常に多くなり、そのたびに、前述のマスフローコントローラの応答遅れ待時間が 20発生する。このため、時間のロスが大きく生産性向上の障害となっている。また、無駄に流れるガスの量が無視しえないほど多くなってしまう。このことは、プロセスガスが高価であることから当然にコスト高をもたらす。さらに、使用後の有害なプロセスガスをそのまま環境に放出しないために排気系に設けられている除害装置にも余計な負担をかけることとなる。

【0012】本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、流量計の出力値に応じて流量制御を行う流量制御弁において、ガス供給開始時の流量計 30の応答遅れを補償する遅れ補償手段を備えることにより、無駄な応答安定待ち時間やガス消費なく的確に所定のガスを供給でき、したがって生産性がよくガス排気系にも余計な負担をかけないすぐれた遅れ補償機能付流量制御弁を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に本発明の遅れ補償機能付流量制御弁(1)は、気体の 流量を調整する流量調整手段と、その気体の実流量を測 定する流量計とを有し、その流量計の出力値により流量 40 調整手段を制御する流量制御弁であって、前記流量計の 出力値変化の時間遅れを補償する遅れ補償手段を備えた ものである。

【0014】また、本発明の遅れ補償機能付流量制御弁(2)は、前記遅れ補償手段が、時定数の異なる複数の 1次遅れ関数を併用して前記流量計の出力値変化の時間 遅れを補償することを特徴とするものである。また、本 発明の遅れ補償機能付流量制御弁(3)は、前記遅れ補 償手段が、1つの1次遅れ関数により前記流量計の出力 値変化の時間遅れを補償することを特徴とするものであ 50 る。

[0015]

【作用】前記構成を有する本発明の遅れ補償機能付流量制御弁(1)では、ガス定常供給中は、流量計の出力値により流量調整手段が制御され所定の流量を維持している。ガス供給開始時は、流量計の応答性により、流量計出力値の変化が実流量の変化より時間的に遅れるので、遅れ補償手段がこれを補償して、応答遅れをキャンセルした信号を流量調整手段に送る。これにより、ガス供給開始後、早期にガス流量が安定する。

【0016】また、本発明の遅れ補償機能付流量制御弁(2)では、遅れ補償手段が時定数の異なる複数の1次遅れ関数を併用して応答遅れをキャンセルするので、ガス供給開始後、早期にガス流量が立ち上がるとともに、所定値に安定する。また、本発明の遅れ補償機能付流量制御弁(3)では、1つの1次遅れ関数を併用して応答遅れをキャンセルするので、ガス供給開始後、早期にガス流量が立ち上がる。

[0017]

【実施例】以下、本発明の遅れ補償機能付流量制御弁を 具体化した実施例を図面を参照して説明する。図1に、 第1の実施例に係る遅れ補償機能付流量制御弁1の構成 を断面図で示す。遅れ補償機能付流量制御弁1は、左側 の流量計部2と右側の電磁弁部3とを有している。

【0018】流量計部2は、主通路27の左側に入力ポート32が開口している。また、主通路27の中央部に内壁と所定の間隔をもって柱状部材35が保持されている。また、柱状部材35の両側の内壁に流入口23aと流出口23bとが開口し、導管23が付設されている。そして、内部をガスFが流れる導管23の上流側と下流側に感熱コイルC1、C2がUV硬化樹脂等で接着されている。感熱コイルC1、C2は、各々温度係数の大きな一対の自己加熱型測温体を巻き付けて形成したものであり、互いに等しい抵抗値を有している。

【0019】そして感熱コイルC1、C2は定温度制御回路24に接続されている。定温度制御回路24は感熱コイルC1、C2を要素とするブリッジ回路を含んでおり、感熱コイルC1、C2の温度を一定値に制御しつつ、導管23を流れるガスFの流量をブリッジ回路間の電位差より演算するものである。

【0020】電磁弁部3はガス流量の調整を行う部分であり、その中心には、中空円筒状のコイルボビン29の胴部に銅線が巻かれたコイル28がある。また、コイルボビン29の中空部の右側に通孔が形成されている板ばね34が内壁面に固定され移動可能な弁体30が保持されている。また、弁体30の右側に出力ボート33が穿設されている。また、弁体30の対抗する位置に、入力ボート32と出力ボート33とを連通させる弁座31が設けられている。また、コイル28には、電磁弁駆動回路26が接続されている。電磁弁駆動回路26は、遅れ

補償回路5を介して流量制御回路25に接続されてお り、その流量制御回路25は定温度制御回路24に接続 されている。

【0021】次に遅れ補償機能付流量制御弁1の作用を 説明する。入力ポート32から出力ポート33に向けて ガスFを流すと、ガスFは導管23の内部と主通路27 とに分かれて流れ、その流量比は一定となる。一方、感 熱コイルC1、C2は、定温度制御回路24により、そ の温度が常に相等しくかつ一定になるように制御され る。このとき、導管23を流れるガス下により感熱コイ 10 ルC1からC2に熱が運搬されるので、感熱コイルC1 にはより多くの熱を発生させるべくより大きな電圧が印 加される。この、感熱コイルC1、C2に印加される電 圧の差は、ガストの流量に比例する。そして定温度制御 回路24はその内部のブリッジ回路によりこの電圧差を 流量制御回路25に出力する。

【0022】そしてこの電圧差により流量制御回路25 が流量を演算する。かかる流量値は、ガスFの実際の流 量変化に対して時間遅れを含んでいるので、遅れ補償回 路5により時間遅れの補償を受けた上で、必要な流量が 20 得られるように電磁弁駆動回路26に流量指令として伝 達される。との遅れ補償作用については後述する。流量 指令を受けた電磁弁駆動回路26は、指令された流量が 流れるように電磁弁部3の開度を調節する。そして、そ の流量を所定時間流すと電磁弁部3への通電が遮断され 弁が閉じることにより、ガスFの流れを遮断する。これ により、所定の総流量のガスFが送られるものである。 【0023】次に図2に、遅れ補償機能付流量制御弁1 を使用するガス供給システムの構成を示す概念図を示 す。図2では、ガスを貯蔵するガス源10から、レギュ 30 ることが読み取れる。 レータ12により適宜減圧されたガスが導管22を経由 し、遅れ補償機能付流量制御弁1を通じて処理槽74に 供給される。導管22には、レギュレータ12の前段に フィルタ11が、レギュレータ12と遅れ補償機能付流 量制御弁1との間に圧力計16が、遅れ補償機能付流量 制御弁1の後段にガスの流量を絞るニードル弁15が、 それぞれ設けられている。更に、レギュレータ12、圧 力計16、ニードル弁15のそれぞれ後段にストップ弁 17、18、14が配置されている。このうちストップ 弁14については、操作用圧縮空気21により開閉操作 40 がされるようになっており、そのための3方電磁弁20 とこの電磁弁20に信号を印加するスイッチ19とが備 えられている。

【0024】また、図2のシステムでは、X-Yデコー ダ4を設けている。X-Yデコーダ4は、遅れ補償機能 付流量制御弁1の流量制御回路25または遅れ補償回路 5からの出力をモニタするものであり、通常の使用状況 では不要であるが遅れ補償回路5の効果を測定するため に特に設けたものである。また、スイッチ19により印 加される電気信号は、X-Yデコーダ4にもモニタされ 50

る。かかるガス供給システムで、ニードル弁15及びX -Yデコーダ4は、遅れ補償機能付流量制御弁1の遅れ 補償回路5の効果を測定するために特に追加したもので あって、通常のガス供給システムとして使用する場合に は不要である。

【0025】次に、遅れ補償機能付流量制御弁1におけ る、流量値の遅れ特性および遅れ補償回路5の効果の測 定について説明する。遅れ補償機能付流量制御弁1にお ける流量値の遅れ特性を測定するためには、最初にガス 供給流量を設定しなければならない。かかるガス供給流 量の設定は以下の手順による。

【0026】まず、ストップ弁14が閉じられているの を確認し、ガス源10の元栓を開いてレギュレータ12 に元圧を印加する。この測定ではストップ弁17、18 は常時開とする。そして、レギュレータ12を所定の圧 力(CCでは1kgf/cm²とする)に設定する。つ いで、遅れ補償機能付流量制御弁1の電磁弁部3を全開 状態に固定する。そして、遮断弁14を開いて、所定の 流量(ここでは375sccmとする)が流れるように ニードル弁15を調整する。以上でガス供給流量の設定 が終了したので、一旦遮断弁14を閉じる。

【0027】そして、遅れ特性の測定を行う。まず、流 量計部2 における流量値の純粋遅れ特性を以下の手順で 測定する。遅れ補償回路5をスルーさせ、電磁弁部3を 全開状態に固定したままとする。そして、遮断弁14を 開き、以後の流量制御回路25の出力値をX-Yデコー ダ4から出力する。このときの測定値の例を図8のグラ フ中カーブaに示す。カーブaでは、流量制御回路25 の出力値が所定の流量に落ち着くまで約4秒かかってい

【0028】かかる遅れは、流量制御回路25の出力値 の実流量に対する応答遅れである。この遅れには1次遅 れの要素が大きく含まれていると考えられるので、これ を1次遅れ要素とそれ以外の遅れ要素との重畳であると する。そして、1次遅れ要素をE(s)で表し、それ以外 の遅れ要素は伝達関数が解明されないので以後「解明さ れていない伝達関数」と呼び、F(s)で表す。そして本 実施例は、遅れ要素F(s)の寄与は小さいとして、1次 遅れ要素 E(s)を補償することにより全体の遅れを補償 しようとするものである。なお、1次遅れE(s)は、次 式で表される。

 $E(s) = 1/(1+s*\tau_1)$

CCでτ、は流量制御回路25の応答の時定数を、sは ラプラス演算子と呼ばれる複素関数を示す。

【0029】これを図5の概念図で考えると、入力V ı(s)に対する出力V。(s)がカーブaとして表れてい る。そこで、遅れ補償回路5をオンすることにより、こ れを補償して出力Vour (s)とするのである。ここで、 遅れ補償回路5による遅れ補償の伝達関数を、

7

$$G(s) = \{1 + s *(a + \tau_1)\}/(1 + s *\tau_1)$$
 (1)

とする。ことでさらに、

$$a + \tau_i = \tau_i$$

となるように回路を組めば次式が得られる。

$$G(s) = (1 + s * \tau_1) / (1 + s * \tau_2)$$

【0030】従って図5は図6のように表すことができ る。さらに、(1)式と(3)式とから、 $E(s)*G(s) = 1/(1+s*\tau_1)$ であるから、図6を図7のように書き換えることができ

*10

 $a = 0.9 * \tau_1$

とすると、

る。

$$\tau_1 = 0.1 * \tau_1$$

となり、て、はて、の10分の1となる。

【0032】次に、遅れ補償回路5の伝達関数G(s)を ブロック線図化する。入力をX、出力をYとすれば、

(3)式より次式のように表される。

 $Y = \{(1 + s * \tau_1)/(1 + s * \tau_2)\}*X$ これを変形して、

 $Y + s * \tau_2 * Y = X + s * \tau_1 * X$

 $Y = X/(s *\tau_1) - Y/(s *\tau_1) + X*(\tau_1/\tau_1)$ $Y = X + \{(\tau_1 - \tau_2)*X - (Y - X)/s\}/\tau_2$ となり、これより図4のブロック線図が得られる。

【0033】このブロック線図は、例えば図3のような アナログ回路として実現される。との回路は、差動入力 型オペアンプを3基使用して補償回路5を実現した例で ある。すなわちオペアンプA1、A2により非反転増幅 回路を形成し、オペアンプA3により反転増幅回路を形 成したものである。との回路では、入力信号V1をP1 入力端子に、他方を抵抗R1及びR3を介してオペアン・ プA2の+入力端子に、それぞれ入力させている。ま た、抵抗R1とR3との間のP3点は抵抗R2を介して 接地されている。

【0034】オペアンプA1の出力端子は出力信号V1 Oとなるほか、抵抗R11を介してオペアンプA1の-入力端子に入力される。またオペアンプA1の-入力端※

$$V2 = 0.9 * V1$$

となる。また、オペアンプA3の一入力端子の電位V5 は、接地にイマジナリショートされているので、 V5 = 0*

I I = V 7 / R 7

となる。

【0037】また、コンデンサCの電荷Qについては、 オペアンプA3の出力端子電位をV4として、

Q = -V4*C

V4 = -(1/C)*Ildt

众

【0038】(8)式に(7)式を代入すると、 $V4 = -\{1/(C*R7)\}* \int V7dt$ となり、これをラプラス演算子sを用いて表すと、 *【0031】との結果、流量制御回路25の1次遅れ応 答の時定数で、は、遅れ補償回路5により相殺され、新 たな時定数で、の1次遅れ応答になったことになる。こ こで、相殺するための条件は、(2)式であるから、

(4)

(2)

(3)

(5)

※子は、抵抗R10を介して接地されている。オペアンプ A2の出力は抵抗R8を介してオペアンプA1の+入力 端子に入力されるほか、抵抗R6を介してオペアンプA 2の-入力端子に入力される。またオペアンプA2の-入力端子は、抵抗R5を介して接地されている。

【0035】そして、オペアンプA2の出力はP4点で 20 分岐され、抵抗R7を介してオペアンプA3の-入力端 子に入力される。オペアンプA3では-入力端子と出力 端子とがコンデンサCを介して接続されており、+入力 端子は接地されている。オペアンプA3の出力は、抵抗 R4を介してオペアンプA2の+入力端子に入力され る。との回路において、補償しようとする1次遅れの時 定数を1sとすれば、各抵抗器の抵抗値及びコンデンサ の容量は、R1、R5が1kQ、R2が9kQ、R3、 $R4M47k\Omega$, $R6M19k\Omega$, $R7M500k\Omega$, R8乃至R11が10kΩである。そして、R4とR6 点で分岐し一方を抵抗R9を介してオペアンプA1の+ 30 との間に配設されているコンデンサCの容量は、2μF である。

> 【0036】次に、図3の回路図の検証を行う。入力電 位をV1として、まず、P3点の電位V2は、オームの 法則より、

 $V2 = V1*{R2/(R1+R2)}$

であり、前記よりR1が1kΩ、R2が9kΩであるか ろ、

(6)

★となる。従って、抵抗R7を流れる電流 I1は、P4点 40 の電位をV7とすれば、

(7)

☆と表される一方、電流Ⅰ1の積分値でもあるから、 $Q = \int I \cdot I \cdot dt$

であり、これらによりV4が求められる。

(8)

 $V4 = -\{1/(C*R7)\}*V7*(1/s)$ が得られる。ととではCが $2\mu F$ 、R7が $500k\Omega$ で 50 あるからこの式は、

れる。

との式は、

*R11

1との関係式は、

V4 = -V7/s

10 (9)

となる。

【0039】そして、オペアンプA2の+入力端子の電 位V3については、

V3 = (V2 + V4)/2,

が得られる。V3は、イマジナリショートによりオペア ンプA2の-入力端子電位V6と等電位なので、

V3 = V6

× I2 = V6/R5 = V3/R5

【0040】一方 I 2は、抵抗R6を流れる電流と等し 10★ V7 = V3*{1+(R6/R5)} いので、

I2 = (V7 - V6)/R6 = (V7 - V3)/R6であり、これに(11)式を代入して次式が得られる。★

V7 = 20 * V3

となる。

【0041】次にP2点の電位V8については、

 $V8 = (V1 - V7)*{R8/(R8 + R9)}+V7$

V8 = (V1 + V7)/2

そして、V8はイマジナリショートによりオペアンプA \bullet V8 = V9

1の−入力端子電位V9と等しいので、

◆20 である。よって、抵抗R10を流れる電流 I3は、

I3 = V9/R10 = V8/R10

である。

【0042】また13は、抵抗R11を流れる電流と等 しいので、

I3 = (V10-V9)/R11 = (V10-V8)/* となり、前記のようにR10はR11と等しいので、

V10 = 2*V8

が得られる。

【0043】次に、(10)式と(12)式とより、

V7 = 10*(V2+V4)

× $V7/V1 = 9/\{1+(10/s)\}$

となる。一方、(13)式、(15)式より、V8を消 ★が得られる。そして、この式と(16)式とによりV7 去すると、

V10 = V1 + V7

(s)を示している。

を消去すると、

 $V10/V1 = (1+s)/\{1+(s/10)\}$

となり、これは遅れ補償回路5の伝達関数、すなわちG ☆【0044】したがって、(3)式と(17)式との対

比により、 \Rightarrow

 $\tau_1 = 1$ $\tau_2 = 1/10$

であることがわかる。ここで(1)式に、(4)式、

(5)式、(18)式、および(19)式を代入すると 40 ス供給開始時の立ち上がりが非常に速い。 とにより(17)式が得られることから、(17)式が 正しいことがわかる。

【0045】以上のようにして遅れ補償回路5は、流量 制御回路25の出力の応答遅れを補償して電磁弁駆動回 路26にフィードバックする。かかる遅れ補償回路5に より $\tau_1 = 1.22$ s e cの1次遅れ関数で応答遅れの補 償がなされた出力を、図8中カーブb に示す。応答遅れ の補償がされていない図8中カーブaに比して、格段に 短い応答時間で、一定値に落ち着いていることが理解で (1.8)

(19)

れ補償回路を有しない従来の流量制御弁と比較して、ガ

【0046】従って、多種類のガスを使用する系に本実 施例の遅れ補償機能付流量制御弁1を使用することによ り、図9に示すように、ガス供給開始後短時間で流量値 を立ち上げさせ、応答待ち時間を減少させることができ る。図9では、1秒以内にすべてのガス流量値が所定値 に達している。

【0047】なお、図8のカーブbにおいて、出力値が 早期に所定の値に達した後(Q点)しばらくの間、出力 値がわずかに低下しているが、これは1次遅れ関数では きる。このため、遅れ補償機能付流量制御弁1では、遅 50 流量の実際の立ち上がりを完全には補正しきれないため

と表され、前記のようにR3とR4とは等しいので、

(10)

 $*V3 = (V2-V4)*{R4/(R3+R4)}+V4$

※となり、この式より抵抗R5を流れる電流 I2が求めら

(11)

前記のようにR6が19kΩ、R7が1kΩであるから

(12)

☆であり、前記のようにR8とR9とが等しいので次式の ように求められる。

(13)

(14)

であり、これに(14)式を代入すると、

 $V10 = V8*{1+(R11/R10)}$

(15)※が得られ、これと(6)式および(9)式よりV7とV

(16)

(17)

である。図11のグラフでとれを説明する。カーブ f は 遅れ補償機能付流量制御弁1のマスフローセンサ(流量 計部2)からの実際の出力を示す。一方、カーブgはモ 1 = 1.22 s e c の 1 次遅れ関数を示す。立ち上がり直 後ではカーブgとカーブfとはよく一致しているが、 j の部分で差を生じている。これが図8のカーブbのQ点 後の出力低下の原因である。

【OO48】カープfの収束部付近に近づけるように時 定数をとると($\tau_1 = 1.76$ s e c:カープh)、安定 は速くなる。しかし、このときの補償した出力は図12 10 受けこれらが合成されたものとして表される遅れであ のカーブmに示すようにオーバーシュート(n)してし まい好ましくない。尚、図12のカーブaは図8のカー*

$$J(s) = \alpha/(1 + s * \tau_3) + \beta/(1 + s * \tau_4)$$
 (21)

 $(\alpha * \tau_4 + \beta * \tau_3)$

 $CCC\alpha$ 、 β は各成分への配分比であり共に正である。 また、 $\alpha + \beta = 1$ である。 τ_3 、 τ_4 は各成分における 時定数である。

【0050】従って遅れ補償回路がこれを完全にキャン セルするためには、遅れ補償回路の伝達関数が、

$$J(s)^{-1} = {(1+s*\tau_1)*(1+s*\tau_4)}/{(1+s*)}$$

$$J(s)*K(s) = 1/(1+s*\tau_0)$$
トオス とこで時学教会 は こ ことはなましなが

とする。ここで時定数 τ 。は、 τ 、 τ 、 ι に比べて十分小 さいものとする。

【0051】ととで、 $\alpha*\tau$ 、 $+\beta*\tau$ 、= τ 、と置けば (21)式のJ(s)は次式のようになる。

$$J(s) = (1 + s * \tau_s) / \{(1 + s * \tau_s) * (1 + s * \tau_s)\}$$

$$K_1(s) = (1 + s * \tau_3) / (1 + s * \tau_5)$$
 (23
 $K_2(s) = (1 + s * \tau_4) / (1 + s * \tau_6)$ (24

とする。

【0052】次にこれをブロック線図化する。K₁(s) とK1(s)とは形式的には同じなのでK1(s) について 考察する。入力をX、出力をYとすれば、

 $Y = \{(1 + s * \tau_3)/(1 + s * \tau_5)\}*X$

であり、これは次式のように変形される。

 $Y = [{(X-Y)/s} + \tau, *X]/\tau,$

これより、図14のブロック線図が得られる。K2(s) についても同様なので入力をY(K1(s)の出力)、出 力をZとすれば、K(s)全体のブロック線図は図15の ようになる。これをアナログ回路として実現するには、 例えば図16のようなものが考えられる。

【0053】この回路は、オペアンプA4を中心に構成 されたK₁(s) 相当部分と、オペアンプA5を中心に構 成されたK₂(s) 相当部分とを直列接続したものであ る。入力信号Xは、抵抗R12とコンデンサC3との並☆

$$X-V11 = I4*R12$$

 $X-V11 = (1/C3)*I5dt$

とこで、 I 4 は抵抗 R 1 2 を流れる電流であり、 I 5 は ◆をラプラス演算子 s を用いて書き直すと、

コンデンサC3の導線に流れる電流である。(26)式◆

(X-V11) = (1/C3)*I5*(1/s)

(27)

となる。 50 【0056】 I 4と I 5との合計が抵抗R 1 3 に流れる

* ブaと同じものである。このことは、次に述べる第2実 施例で解決されるものである。

12

【0049】次に、本発明の第2の実施例について説明 する。第2の実施例は、前記第1実施例とほぼ同様の構 成を有するものであるが、遅れ補償回路において1次並 列遅れ関数で近似した補償を行うようにしたものであ る。そこで、この遅れ補償機能のみ説明することとす る。まず1次並列遅れとは、入力信号が図13に示すよ うに並列に2分されそれぞれ時定数の異なる1次遅れを る。1次並列遅れの伝達関数J(s)は次式で表される。

(21)

であればよいのだが完全なキャンセルは、完全微分が困 難なためできない。そとで、遅れ補償回路の伝達関数を K(s)とし、K(s)でJ(s)をキャンセルしたときに時 定数の非常に小さい1次遅れ関数になるようにする。即

(22)

★これを用いて(22)式のK(s)を表すと、

 $K(s) = \{(1+s*\tau_3)*(1+s*\tau_4)\}/\{(1+s*\tau_4)\}$ $(1 + s * \tau_0)$

が得られる。便宜上、 $K(s) = K_1(s)*K_2(s)$ と考 え、

(23)

(24)

☆列体を介してオペアンプA4の+入力端子に入力され 30 る。オペアンプA4の+入力端子は抵抗R13を介して 接地されている。オペアンプA4では、出力端子と-入 力端子とが抵抗R15を介して接続されており、また-

入力端子は抵抗R14を介して接地されている。 【0054】そしてオペアンプA4の出力は、抵抗R1 6とコンデンサC4との並列体を介してオペアンプA5 の+入力端子に入力される。オペアンプA5の+入力端 子は抵抗R17を介して接地されている。オペアンプA 5では、出力端子と-入力端子とが抵抗R19を介して 接続されており、また-入力端子は抵抗R18を介して

40 接地されている。そしてオペアンプA5の出力が、出力 信号乙となる。

【0055】との回路の、K₁(s)相当部分の入出力信 号の関係を求める。まず、オペアンプA4の+入力端子 の電位V11について次の各式が成り立つ。

(25)

(26)

13

電流 I6となり、

16 = V11/R13

が成り立つので、(25)式と(27)式とから次式が 成り立つ。

14

*V11/R13 = (X-V11)/R12 + s*C3*(X - V 1 1)

これより、V11が求められる。

 $V11 = (R_{\mu}/R12)*\{(1+s*C3*R12)/(1+s*C3*R_{\mu})\}*X$

(28)

ととで、

 $R_N = (R12*R13)/(R12+R13)$ とした。

V12 = I7*R14

そして出力端子の電位V13については、次式の関係が 成り立つ。

V13 = V12 + I7*R15

この式と(29)式とから、

 $V13 = \{(R14 + R15)/R14\}*V12$

が導かれ、V12はイマジナリショートによりV11に 等しいので、

※【0057】一方、オペアンプA4の-入力端子の電位 V12は、抵抗R14及びR15に流れる電流をI7と して次式で表される。 Ж,

(29)

 $\bigstar V13 = \{(R14+R15)/R14\}*V11$ が得られる。

【0058】これに(28)式を代入すれば次式のよう になる。

 $V13 = B*{(1+s*C3*R12)/(1+s*C3*R12)}$ R_n)}*X

ととで、 \star

 $B = \{(R14+R15)/R14\}*(R_{H}/R12)$ $= \{(R14+R15)/R14\}*\{R13/(R12+R13)\}$

とした。Bが1となる必要十分条件は、R13とR14 20分で、そのように回路を組めばV13は、 とが等しくかつR12とR15とが等しいことであるの☆

> $V13 = \{(1+s*C3*R12)/(1+s*C3*R_n)\}*X$ (30)

となる。

【0059】K₁(s) 相当部分についても同様の考察に◆ れ等しくなるように回路を組めば、

 $Z = \{(1+s*C4*R16)/(1+s*C4*R_n)\}*V13$

が得られる。ここで、

 $R_N = (R16*R17)/(R16+R17)$ である。

【0060】(30)式、(31)式により、(23) 式の τ ,、 τ ,、(24)式の τ ,、 τ 。が次のように求 30 ける安定待ち時間の無駄なガス流出を大幅に減少すると まる。

 $\tau_{3} = C3*R12$

 $\tau_4 = C4*R16$

 $\tau_s = C3*R_{\mu}$

 $\tau_0 = C4*R_N$

これらを満たすように各素子を選択して回路を組むこと により、1次の並列遅れの補償回路が実現される。

[0061] CCC, α =0.06; β =0.94, τ , = 7.8 sec. τ_{\bullet} = 1.1 sec. τ_{\circ} = 0.01 se c、 $\tau_s = \alpha * \tau_A + \beta * \tau_S = 7.398 s e c$ 、となるよ 40 るが、これらを一体に組んだ回路としてもよい。また、 うに回路を作成し、遅れ補償を行った結果を図18及び 図19に示す。図19は図18の時間軸を拡大したもの である。補償後の出力は立ち上がりも素早く、かつ、立 ち上がり後の出力の低下も見られない。これは、図17 のグラフに示すように、マスフローセンサの実際の出力 値(実線)と1次の並列遅れの波形(破線)とが非常に よく一致しているからである。従って、これをガス使用 装置に適用することにより、ガス供給開始後短時間で流 量を立ち上げかつ安定させることができる。

【0062】以上詳細に説明したように本実施例の遅れ 50 た、流量計部を感熱コイルにより構成したが、他の手段

◆より、抵抗R17とR18、R16とR19、をそれぞ

(31)

補償機能付流量制御弁1では、ガス供給開始時に遅れ補 償回路5が流量計部2の出力の応答遅れを補償して電磁 弁部3にフィードバックするので、ガス供給開始後短時 間で流量が安定する。このため、ガス供給開始直後にお とができる。これにより、生産性を向上し、ガス排気系 への負担も軽減することができる。特に、ガス供給開始 動作の頻度が高い、枚葉式処理を行うプロセス装置への ガス供給系に適用すると効果が大きい。

【0063】なお、前記各実施例は本発明を何ら限定す るものでなく、その要旨を逸脱しない範囲内において、 種々の変形、改良が可能であることは勿論である。例え ば、図1に示す遅れ補償機能付き流量制御弁1では、流 **量制御回路25と遅れ補償回路5を別々の回路としてい** 前記第2実施例では2種類の1次遅れ関数を並列させた が、3種類以上の1次遅れ関数を並列させてもよい。 【0064】また、前記各実施例では、遅れ補償回路5 としてオペアンプにより組んだアナログ回路を使用して いるが、流量制御弁にマイコン等を組み込んだ場合に は、そのマイコンのソフトに同様の遅れ補償機能を包含 させ、アナログ回路に替えることができる。更に、前記 各実施例では、流量の調整を行う部分を電磁弁により構 成したが、電磁弁以外のものにより構成してもよい。ま

により構成してもよい。

[0065]

【発明の効果】以上説明したことから明かなように本発明では、流量計の出力値に応じて流量制御を行う流量制御弁において、ガス供給開始時の流量計の応答遅れを補償する遅れ補償手段を備えることとしたので、無駄な応答安定待ち時間やガス消費なく的確に所定のガスを供給でき、従って生産性がよくガス排気系にも余計な負担をかけない優れた遅れ補償機能付流量制御弁を提供できる。

【0066】特に、1次遅れ関数を用いて遅れ補償を行うので、ガス供給開始後のガス流量の立ち上がりに優れた遅れ補償機能付流量制御弁を提供できる。更に、時定数の異なる複数の1次遅れ関数を並列させて補償を行うこととすれば、ガス流量の立ち上がり及びその後のガス流量の安定性に優れた遅れ補償機能付流量制御弁を提供できる。本発明は特に、多種類のガスを同時使用する装置や、枚葉処理を行う装置へのガス供給系に適用するとその効果が大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の遅れ補償機能付流量制御弁の構成を示す断面図である。

【図2】本発明の遅れ補償機能付流量制御弁を使用する ガス供給システムの構成を示す概念図である。

【図3】本発明の遅れ補償機能付流量制御弁に使用する 遅れ補償回路の例を示す回路図である。

【図4】図2に示した回路図から導出したブロック線図である。

【図5】遅れ補償機能付流量制御弁における信号の伝達 を示す概念図である。

【図6】遅れ補償機能付流量制御弁における信号の伝達 を示す概念図である。

【図7】遅れ補償機能付流量制御弁における信号の伝達を示す概念図である。

【図8】流量計および遅れ補償回路の出力値の経時変化*

*を示すグラフである。

(9)

【図9】本発明の遅れ補償機能付流量制御弁により多種類のガスを使用する系でのガス流量の経時変化を示すグラフである。

【図 10】従来の流量制御弁により多種類のガスを使用する系でのガス流量の経時変化を示すグラフである。

【図11】マスフローセンサの出力に対する1次遅れ関数による補償を説明するグラフである。

【図12】1次遅れ関数で早期に安定するように次定数 10 をとった場合のオーバーシュートを説明するグラフであ る。

【図13】1次並列遅れによる補償を説明する概念図である。

【図14】1次並列遅れの補償回路の全段部分を示すプロック線図である。

【図15】1次並列遅れの補償回路を示すブロック線図である。

【図16】1次並列遅れの補償回路を実現したアナログ回路である。

20 【図17】1次並列遅れの補償回路による遅れ補償の結果を示すグラフである。

【図18】1次並列遅れの補償回路による遅れ補償の結果を示すグラフである。

【図19】1次並列遅れの補償回路による遅れ補償の結果を示すグラフである。

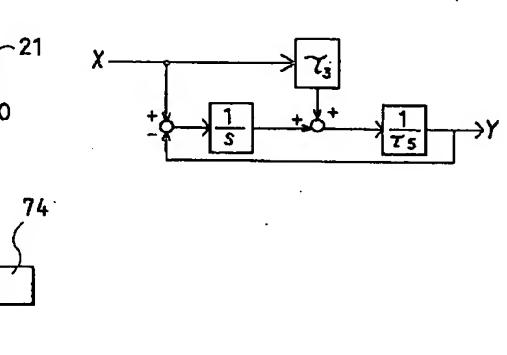
【図20】従来のガス供給システムを示す概念図である。

【図21】従来のガス供給システムでのガスの実流量の オーバーシュートを示すグラフである。

30 【符号の説明】

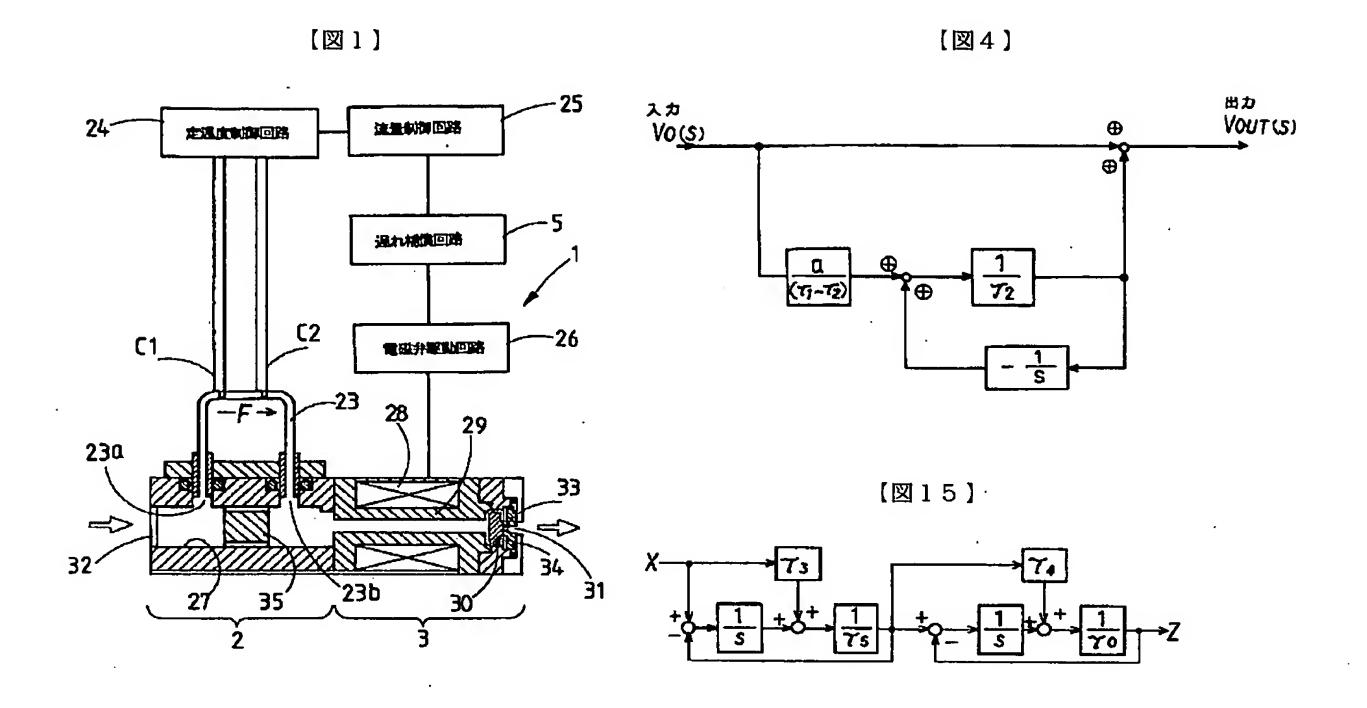
1流量制御弁2流量計部3電磁弁部5遅れ補償回路

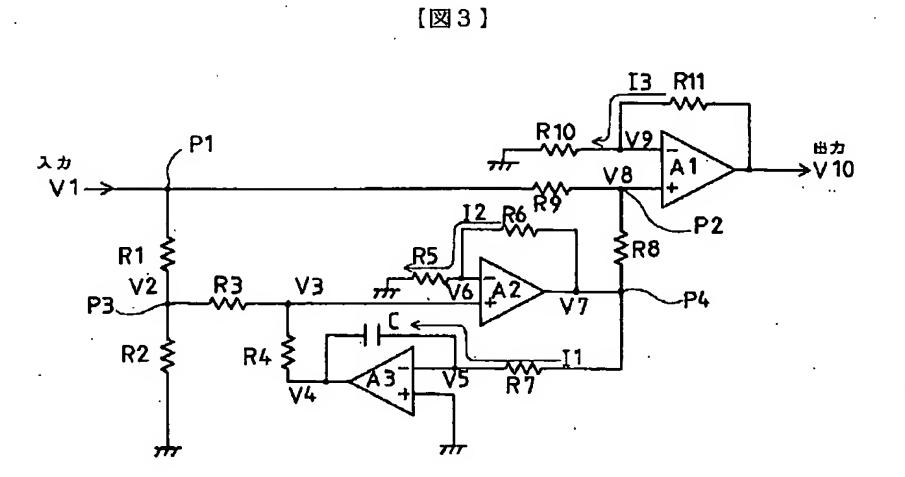
【図2】

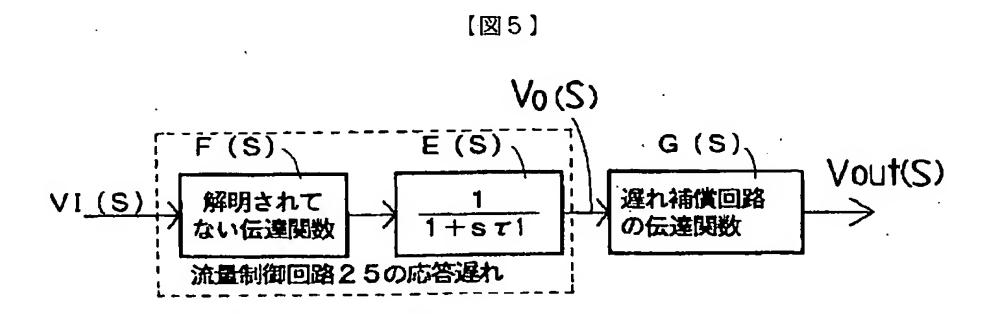


【図14】

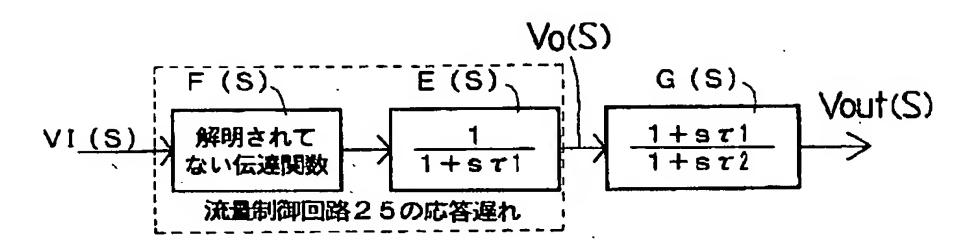
22 16 19 74 22 16 17 18 15 14



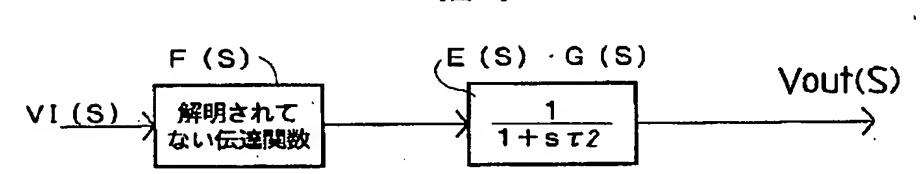






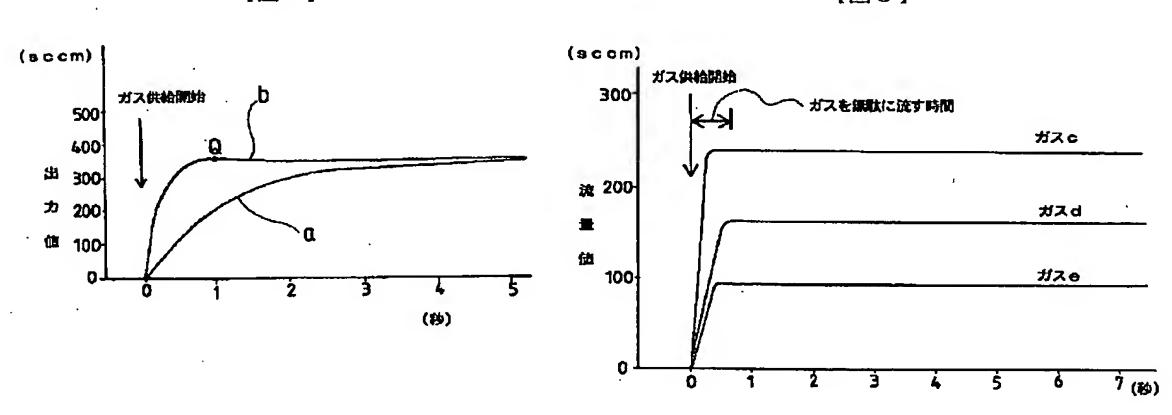


【図7】



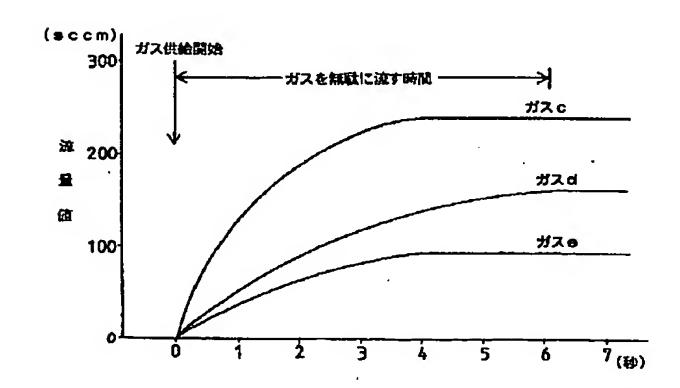
【図8】

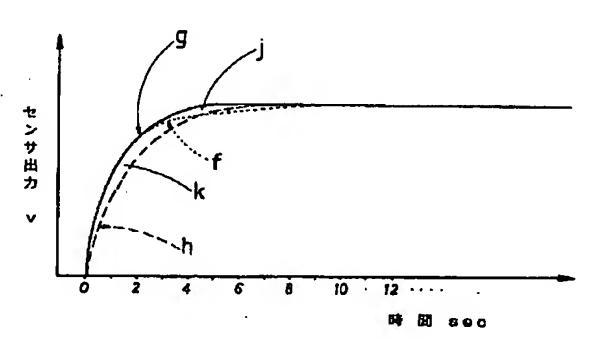
[図9]



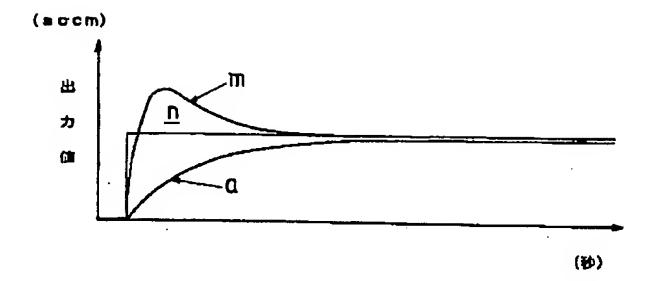
[図10]

【図11】

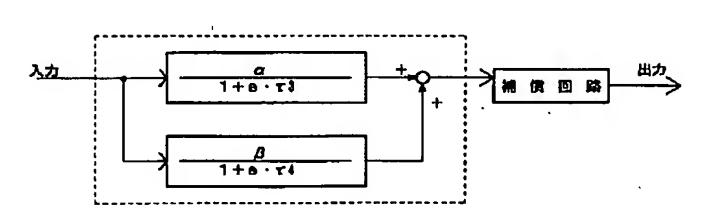




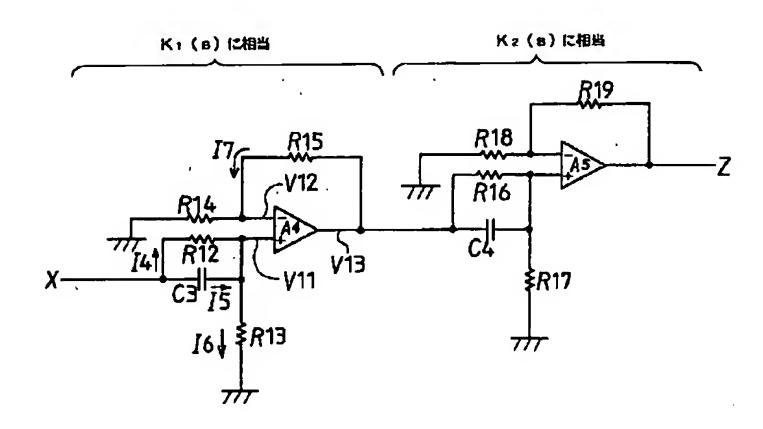
【図12】



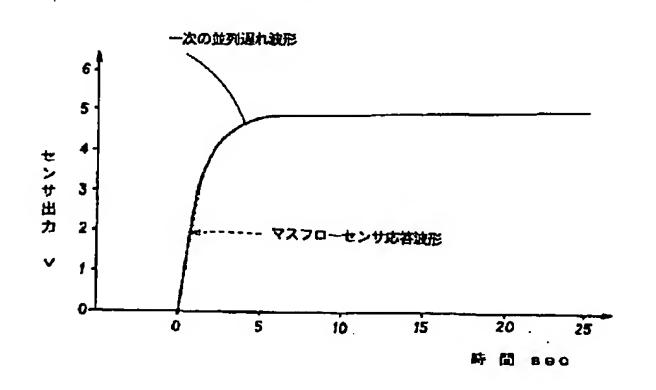
【図13】



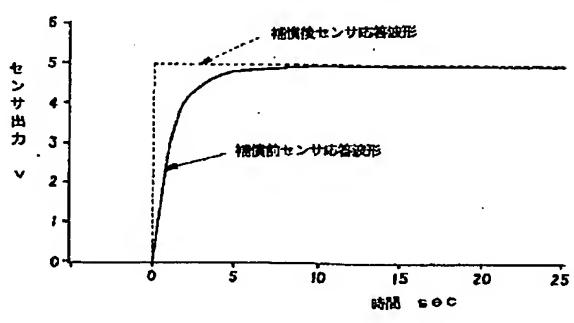
【図16】

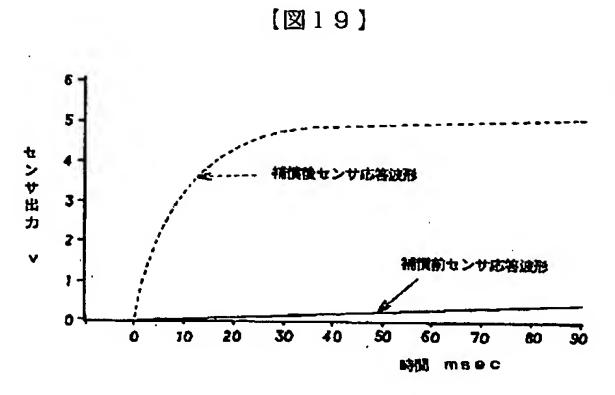


[図17]

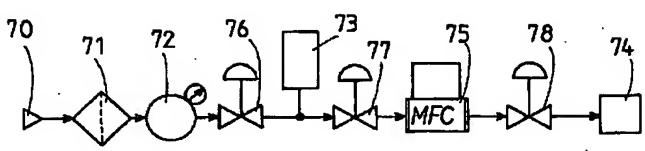


【図18】

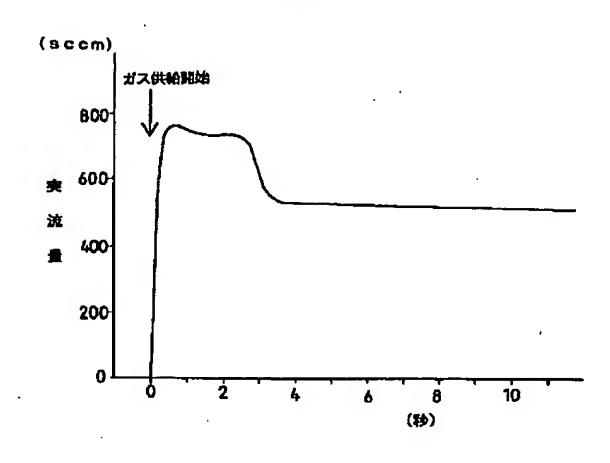




【図20】



[図21]



フロントページの続き

(72)発明者 纐纈 雅之 愛知県小牧市大字北外山字早崎3005 シー ケーディ株式会社内 (72)発明者 新田 慎一

愛知県小牧市大字北外山字早崎3005 シーケーディ株式会社内